# 固相成長テンプレートを用いた Ge(111)基板上への BaSi2 膜作製

Fabrication of  $BaSi_2$  films on Ge(111) using solid phase epitaxy templates

<sup>•</sup>高部 涼太<sup>1</sup>, 原 康祐<sup>2</sup>, 都甲 薫<sup>1</sup>, 宇佐美 徳隆<sup>3,4</sup>, 末益 崇<sup>1,4</sup>

(1.筑波大学電子・物理工学専攻, 2.山梨大学, 3.名古屋大学, 4. JST-CREST)

<sup>°</sup>Ryota Takabe<sup>1</sup>, Kosuke O. Hara<sup>2</sup>, Kaoru Toko<sup>1</sup>, Noritaka Usami<sup>3,4</sup>, Takashi Suemasu<sup>1,4</sup>

(1.Univ. Tsukuba, 2.Univ. Yamanashi, 3.Nagoya Univ. 4.JST-CREST)

E-mail: bk200911087@s.bk.tsukuba.ac.jp

### 【背景・目的】

新規高効率薄膜太陽電池の材料として、斜方 晶 BaSi, について研究を行っている。BaSi, は大 きな光吸収係数(α=3×10<sup>4</sup> cm<sup>-1</sup> @1.5 eV)と非常に 長い少数キャリア拡散長(L<sub>h</sub>~10 μm)を併せ持つ 特異な材料である<sup>1,2)</sup>。また、太陽電池に適した 禁制帯幅(E,=1.3 eV)を持つことも分かっている<sup>1)</sup>。 そのため、BaSi2は、太陽電池の高効率化と薄膜 化を同時に達成できるポテンシャルを秘めた材 料であるといえる。BaSi2は Si(111)面上にエピタ キシャル成長が可能である<sup>3)</sup>。しかし、BaSi<sub>2</sub>/Si 界面にはバンド不連続が存在し、キャリア輸送を 阻害する要因になっている。現在、この BaSi2/Si 界面に存在するバンド不連続を解消する新たな アイデアの一つとして、Ge 基板上の BaSi2 エピタ キシャル膜作製を提案している。しかし、Ge(111) 基板上に直接 BaSi2を成長すると、アイランド状 の粒を形成し、その隙間から酸素が侵入して BaSi2 全体が酸化することが分かった。本研究で は、Ge(111)基板上 BaSi2 のアイランド化を解消す るために、Ge と BaSi<sub>2</sub>の間に固相成長(SPE)層を 挿入することで表面改質を行い、BaSi2 膜の均質 化を目指した。

#### 【実験】

Fig. 1 に示す手順で BaSi<sub>2</sub> 膜の作製した。ま ず、低抵抗 *p*-Ge(111) ( $\rho \leq 0.01 \Omega$ ·cm)を HCl および HF 処理した後、600 °C のサーマルクリーニング を行い、その後 100 °C まで基板温度を下げ、a-Si と Ba を同時に堆積した。次に、580 °C で 20 min のポストアニールを行い、SPE-BaSi<sub>2</sub>を作製した。 そして、この層をテンプレートとし、分子線エピ タキシー(MBE)法により成長温度 580 °C で BaSi<sub>2</sub> 膜を成長した。



Fig. 1 Growth procedure of MBE-BaSi\_2/SPE-BaSi\_2/Ge(111).

## 【結果・考察】

Fig. 2 に SPE 成長後および MBE 成長後の RHEED 像を示す。電子線は Ge[11-2]から入射し ている。この図より、SPE 成長後にストリークパ ターンとなったため、BaSi2 がエピタキシャル成 長したことが示唆されるが、MBE 成長後にリン グパターンとなり、BaSi2 が多結晶化したことが 分かった。Fig. 3 に集中法による 2θ-ω XRD 測定 の結果を示す。また、比較のために Ge(111)基板 のみを測定した結果も示す。これより、Ge(111) 基板上に多結晶 BaSi2 が成長していることが分か った。また、粉末回折のピーク強度と比較して、 BaSi<sub>2</sub>(400)や BaSi<sub>2</sub>(600)からの回折ピークが強く 出ていることが分かった。そのため、わずかなが ら BaSi<sub>2</sub>が a 軸に配向していることが分かった。 さらに、試料表面を AFM により観察したところ、 BaSi2がアイランド化しておらず、Ge 基板全体を 覆えていることが分かった。

#### 【参考文献】

- 1) K. Toh et al., Jpn. J. Appl. Phys. 50 (2011) 068001.
- 2) M. Baba et al., J. Crystal Growth 348 (2012) 75.
- 3) Y. Inomata et al; Jpn. J. Appl. Phys. 43 (2004) 4155.



